研究論文

Received July 25, 2006; Accepted March 9, 2007

AgO_x をマスク層とした super-RENS 光ディスクの オーバーライト特性

+

田村 直義*·浮田 宏生**

* 立命館大学大学院理工学研究科 〒525-8577 草津市野路東 1-1-1 ** 立命館大学理工学部 〒525-8577 草津市野路東 1-1-1

Overwrite Characteristics of a Super-RENS Optical Disk Using AgO_x Mask Layer

Naoyoshi TAMURA* and Hiroo UKITA**

- * Graduate School of Science and Engineering, Ritsumeikan University, 1-1-1 Nojihigashi, Kusatsu 525-8577
- ** Faculty of Science and Engineering, Ritsumeikan University, 1-1-1 Nojihigashi, Kusatsu 525-8577

Based on the working mechanism for a silver oxide type super-resolution near-field structure (Ag super-RENS) disk, we realized overwrite performance by applying the reversible conditions of the mask layer. It was initialized as Ag cluster phase by continuous power of 4.0 mW both before writing (P_w =7.0 mW) and before erasing (P_e =5.0 mW, 5 s). Nevertheless, the CNR difference between writing (amorphous) and erasing (crystal) for successive overwrite decreases as the number of the overwriting increases, resulting in 4 times overwrite for the present medium.

Key words: super-RENS, overwrite, AgO_x , GeSbTe, optical data storage

1. はじめに

光ディスクは時代のニーズとともに大容量化してきた が、さらなる大容量化には光の波長と対物レンズの開口数 で決まる分解能(スポットサイズ)に限界がある.この検 出限界を打破する方法のひとつに、波長や開口数に依存し ない super resolution near-field structure (super-RENS) 方式がある.これまで、マスク層として Sb を用いた開口 型^{1,2)}から金属酸化物を用いた散乱型³⁻⁵⁾へと発展し CNR (carrier to noise ratio)を向上してきたが、情報の書き替 えはできなかった.

本稿では、マスク層に酸化銀を用いた散乱型 super-RENS の記録再生メカニズム⁶⁾に基づき、オーバーライ トの可能性を検討した。その結果、初期化を複数回行うこ とでマスク層の酸化銀が可逆変化することを見いだし、記 録および消去前にマスク層だけを再度初期化することによ り、オーバーライトが可能なことをはじめて見いだしたの で報告する.

2. 光ディスクの構成と実験方法

super-RENS ディスクの実験には、市販の媒体評価装 置 (DDU-1000:パルステック社)を使用した。Table 1 に AgO_x型 super-RENS ディスクの諸元を示す。ディス クはマスク層が AgO_x,記録層が GeSbTe の相変化媒体 で (いずれも原理的に可逆変化可能),Table 1のような 六層構造になっている。表中の n は屈折率, k は吸収係 数を表している。また、ディスクの基板厚は 0.6 mm な ので厚み補正用のガラス板 0.6 mm を光ヘッドに取り付 け、本対物レンズ (ディスク厚 1.2 mm 用)の球面収差 を補正した。レーザー波長は λ = 830 nm,対物レンズ開 口数は NA=0.5 なので、本実験の検出限界 (λ /4NA) は 415 nm になる。媒体速度は v=2.0 m/s,通常再生パワー は P_r =1.0 mW,光パルスのデューティー比は 50% であ る。なお、マーク長 1000 nm の場合の光パルス幅は 1000 ns になる。

^{**} E-mail: ukita@se.ritsumei.ac.jp

³⁶巻4号 (2007)

Layer	Material	Thickness [nm]	Phase	п	k
PC sub.	Polycarbonate	0.6×10^{6}		1.56	
Protective	ZnSiO ₂	170		2.25	0.01
Mask	AgO _x	15	AgO ₂ Ag particle	$\begin{array}{c} 2.8\\ 0.04 \end{array}$	0.08 6.992
Protective	ZnSiO ₂	40		2.25	0.01
Recording	$Ge_2Sb_2Te_5$	15	Crystal Amorphous	4.29 3.97	2.09 4.41
Protective	$ZnSiO_2$	20		2.25	0.01

Table 1 Parameters of materials of super-RENS with AgO_x mask layer.



Fig. 1 Relationship between CNR and write power for read power of $P_r = 1.0 \text{ mW}$ with mark length as a parameter.

3. AgO_x型 super-RENS の記録再生メカニズム

散乱型 super-RENS はマスク層に金属酸化物を用いる ことで、ディスク内部に散乱体を形成し近接場光を発生さ せる方式であり、開口型 super-RENS より高い CNR が 得られる。 散乱型 super-RENS はレーザー吸収による熱 分解を利用してマスク層を瞬時に金属微粒子と酸素ガスに 分解し,金属微粒子を散乱体として用いる。 レーザースポ ット周辺に集められた金属微粒子は金属プローブを形成 し、表面プラズモンにより電場増強効果がある。AgOx (酸化銀)を用いた散乱型 super-RENS では、レーザー照 射によりマスク層のAgOx 薄膜が熱分解され、銀微粒子 と酸素ガスに分離する.また、レーザービームの中心に銀 微粒子が集まって光散乱体を形成、金属プローブとして作 用し、プラズモン効果により微小マークを読み出す.この とき,熱分解時における酸素爆発の圧力により保護層が記 録層に押し出されて熱変形するため、ライトワンス記録に なることが報告されている⁵⁾。なお、レーザーパワーを高 くすると、レーザースポットの中心に集まった銀微粒子は 中央に空洞をもつリング構造4,5)となり、金属による微小 開口として作用し、微小マークを読み出す.



Fig. 2 Relationship between CNR and write power for super-RENS readout with mark length as a parameter.



Fig. 3 Working mechanism of a super-RENS with AgO_x mask layer.⁶⁾

Fig. 1 は記録直後における通常再生パワー (P_r =1.0 mW) での CNR の記録パワー依存性, Fig. 2 はマスク層の Ag 粒子をリング構造に変化し超解像検出を可能とする super-RENS 再生時 (P_{rs} =4.0 mW) での CNR の記録パ ワー依存性である. Fig. 1 ではマスク層と記録層の効果が 重畳されるので検出限界以下のマークを検知できないが, Fig. 2 では均一なマスク層中に形成されたリング状の微小 開口により記録層の変化を検出できるため超解像検出が可 能になっている. これらの CNR の記録パワー依存性と文 献⁶⁾ の信号振幅の記録パワー依存性から, Fig. 3 に示すよ うな記録再生メカニズムが明らかになっている.

Fig. 3 で,記録パワー P_w が初期化パワー P_i =3.5 mW より低い場合は記録層に変化はない. P_w =4.0~5.0 mW では記録層がアモルファス化しはじめて記録層の反射率が 低下し、マスク層には初期化で分散されていた銀微粒子が 引き寄せられて凝集体を形成し (c)、マスク層の反射率が 増加するので、両層の効果が重畳して CNR が低下する. P_w =5.5~7.5 mW では記録層のアモルファス化がさらに

+



Fig. 4 Relationship between CNR decrease and erase power with write power as a parameter.

進み CNR は一定値へ収束するが,信号振幅とノイズが記録パワーとともに増加する.一方,マスク層では銀微粒子の凝集が解け(拡散)はじめる(d). P_w =8.0 mW以上では銀微粒子がリング構造へ変化する(e).したがって,反射率が低下し信号が小さくなる.なお,検出可能な最小マーク 200 nm における信号の最大値が得られた記録パワー P_w =8.5 mW をここでの最適記録パワーと定義する.

AgO_x型 super-RENS では、書き替え型 DVD の記録層 と同じ相変化媒体である GeSbTe を用いている.この相 変化媒体の記録/消去状態は、アモルファス(記録)/結晶 (消去)に対応している。相変化材料の温度を融点以上に 上げることで記録(結晶→アモルファス)し、結晶化温度 以上融点以下に保つことで消去(アモルファス→結晶)す る⁷⁾.記録パワー8.5 mWのマークは、super-RENS 再生 (P_{rs} =4.0 mW)しても消去されないことから、消去パワ ーは4.0~8.5 mW の間にあると予測できる。あるいは、 記録パワー8.5 mWで記録層が熱変形(非可逆)してい る可能性もある。また、super-RENS には DVD などには ないマスク層が存在するため、これまでと違った影響が記 録層に表れる可能性がある。これらのことを考慮しつつオ ーバーライトの実験を進めた。

4. 消去パワー,記録パワーの影響

まず,記録マークを消去できるかどうかを調べるため, 記録パワー P_w =5.0~7.0 mW のマークに対し,消去パワ ーを super-RENS 再生パワー P_{rs} =4.0 mW より高い P_e =4.5~6.0 mW として CNR の変化を測定した.消去 はトラック1周分の1回照射,再生パワーは P_r =1.0 mW である. Fig. 4 は,消去動作による CNR の低下量と消去 パワーの関係である.消去パワー P_e =4.5 mW で消去量 が大きく,記録パワー P_w =5.5 mW の場合に最大となっ ていることがわかる.このため,記録パワーを P_w =5.5

20 15 Write power [mW] 9 10 + 5.0 CNR decrease 5 -- #-- 6.0 ----- 6.5 0 4.5 -5 Erase power [mW] -10

+

Fig. 5 Relationship between CNR decrease after super-RENS readout and erase power with write power as a parameter.

mW として記録, 消去, 再記録を試みたが, 再記録によ る CNR の増加はほとんどなくオーバーライトを確認でき なかった.なお, Fig. 4 の P_e =5.0 mW 以上で CNR の低 下量が負 (CNR の増加)になるが, 原因は不明である. この理由は, super-RENS には記録層のほかにマスク層 があるため, 記録を行えば両方の層の変化が重なって信号 として検出されることになるためである.マスク層の状態 だけが変わった場合にも CNR は変化するため, マスク層 に依存しない状態で信号を読み取る必要がある.

次に、記録後、マスク層を初期化 (super-RENS 再生, $P_{\rm rs} = 4.0 \, {\rm mW}$) してから消去実験を行った. Fig. 5 は、初 期化(super-RENS 再生, Prs=4.0 mW)を追加したとき の CNR 低下量と消去パワーの関係である。初期化を追加 することによっても、消去パワーによる CNR の低下がほ とんど現れないことがわかる. $P_{\rm w}=6.0\,{\rm mW}\,\&\,P_{\rm e}=5.5\,{\rm mW}$ と、 $P_{\rm w}$ =6.5 mW & $P_{\rm e}$ =6.0 mW のときに CNR の低下 量が大きいのは、消去は連続光照射、記録はパルス光照射 なので,同じパワーでは連続光のほうが記録層への影響が 大きいためである。つまり、消去動作で無記録の部分が結 晶からアモルファスへ変化したためと考えられる.この場 合も Fig. 4 の場合と同じように、再記録による CNR の増 加はほとんどなかった.これらの実験から,以上の手順 (1回照射の初期化,1回照射の消去)ではオーバーライト できないことがわかり,オーバーライトを実現するために は別の工夫が必要である.

5. マスク層 (AgO_x) の可逆変化条件

前章の実験解析では、マスク層と記録層の効果が重畳し ていたので、記録層の相状態を独立に制御できなかった。 本章では、記録あるいは消去において、マスク層の状態を 一定にする条件(可逆変化条件)を探索し、記録層の相状 態を制御してオーバーライトする方法を考察した。

36巻4号 (2007)

217 (43)



Fig. 6 Reflectivity variation by number of initializations with initialization power as a parameter.



Fig. 7 Reversible characteristics of mask layer by $P_1^{1}=2.5$ mW and $P_1^{u}=3.5$ mW with initialization time as a parameter.

Fig. 6は、初期化パワーP_i=1.8~5.4 mW で作製時の ままの状態からの反射光の変化を30回目まで測定した結 果である。初期化パワーにより変化が異なっているが,照 射回数が増えると安定してくることがわかる。この変化 $lt, P_1 = 1.8 \text{ mW}, P_1 = 2.4 \sim 3.0 \text{ mW}, P_1 = 3.6 \sim 5.4 \text{ mW} \mathcal{O}$ 3つに大別される.まず、 $P_i=1.8\,\mathrm{mW}$ では、照射回数が 増えるごとに反射光が低下し、 $P_i=2.4\sim3.0\,\mathrm{mW}$ では1 回目に反射光が低下し、その後上昇している。Pi=3.6~ 5.4 mWでは1回目に反射光が上昇し、その後低下、そし て再び上昇する. 4.8 mW や 5.4 mW では, 照射回数を 増やすと反射光は低下していく(記録層が徐々にアモルフ ァス化する) ことがわかる. Pi=2.4~3.0 mW のような低 パワーの場合に反射光が照射回数により振動する現象は, 記録層の GeSbTe では考えられないため、マスク層の酸化 銀の反応によるものと考えられる.また、マスク層の状態 は15回程度レーザーを照射することで安定することがわ かる.

次にパワーを変えて照射すると、どのような反応が表れ るか測定した。その結果、4.0 mW で複数回照射して初期 化した後、2.5 mW で照射すると反射光が低下し、3.5 mW



+

Fig. 8 CNR decrease dependence on erase power due to a 5 s erasing process with initialization power as a parameter, where write power is 7.0 mW.

で照射すると反射光が上昇してもとの値に戻ることがわかった. Fig. 7 は, P_i =4.0 mW で初期化回数の異なるディスクに対し, P_i ¹=2.5 mW で 6 回, P_i ^u=3.5 mW で 1 回 照射したときの反射率を初期化後の反射率で規格化したものである。2.5 mW 照射で反射率が低下, 3.5 mW 照射で反射率が上昇と同じ変化を繰り返していることがわかる。照射を繰り返すことで, 2.5 mW での反射光の低下する値が大きくなり,初期化 30 回以上の場合には反射率は 0.88 程度で安定していることがわかる。

ここで、記録層の特性について考えてみる.記録層の GeSbTeは、高パワー照射で結晶からアモルファスに変化 するため反射率が低下し、低パワー照射でアモルファスか ら結晶に変化するため反射率が上昇する.しかし、実験結 果は、2.5 mWの低パワー照射で反射率が低下し、3.5 mW の高パワー照射で反射率が上昇しており、記録層の変化と は逆である。よって、この変化はマスク層の変化であるこ とがわかる。Agより AgO_xの反射率が低いため、 P_1 = 4.0 mWで複数回照射してディスクを初期化した後、 P_1 ¹= 2.5 mWの照射回数で「Ag+O₂→ AgO_x」へ変化、 P_1 ^u= 3.5 mWの照射1回で「AgO_x→ Ag+O₂」へ変化するマ スク層の可逆変化を実現できた。

初期化を複数回行うとマスク層の可逆変化が可能となったため、これまで1回照射で行っていた初期化を、複数回パルス照射と同じ効果を得られる5秒間連続照射(約40回パルス照射に相当)に変更して実験した。また、消去も5秒間連続照射とした。Fig.8は、 P_w =7.0mWの記録マークに対し5秒間連続照射して消去した場合のCNR低下量と消去パワーの関係である。これまでの1回照射ではCNRの低下は5dB程度であったが、複数回照射では最大15dBあることがわかる。以上の条件より、記録マークが消去されている可能性が高いため、最大の変化が得られた P_i =4.5mWの値を初期化パワーとし、オーバーラ

218 (44)

光 学

+



Fig. 9 Overwrite CNRs for different erase powers, where write power is 7.0 mW.



Fig. 10 Overwrite CNRs for different write powers, where erase power is 5.0 mW.

イトの実験を行った。

6. オーバーライト特性

ここでは、長さ1000 nm のマークを記録し、消去した 後,再度マーク長1000 nm を記録するオーバーライトに よる CNR の変化を測定した。Fig. 9 は、 $P_w = 7.0 \text{ mW}$ で 記録 (write 1) したマークに対し, super-RENS 再生パ ワー $P_{\rm rs}(=P_{\rm i})=4.0\,{\rm mW}$ でマスク層を初期化した後,異 なるパワーで5秒間連続消去(erase)し、再び $P_{rs}=4.0$ mWでマスク層を初期化した後,再度記録(write 2)し た場合の CNR 測定結果である. 同図から write 2の記録 で CNR が大きく上昇し,再記録が可能なことがわかる. $P_{\rm e}=4.5\,{\rm mW}$, 5.5 mW での変化に対し, その間の $P_{\rm e}=$ $5.0 \,\mathrm{mW}$ の変化が最も大きいため、この $P_{\rm e}$ = $5.0 \,\mathrm{mW}$ を ここでの最適消去パワーとした。次に、記録パワーを変化 してオーバーライト実験を行った. Fig. 10 から, $P_w = 9.0$ mW では再記録しても変化が表れないため、記録パワー が高過ぎて記録層が熱変形し,不可逆状態になっているこ とがわかる.また, $P_w = 7.0 \, \text{mW}$ の変化が一番大きいた (d) Super-RENS read $P_{e} = P_{e} = 4. \text{ fm}W$ (c) Write $P_{w} = 7.0\text{m}W$





Fig. 12 CNR as a function of number of overwriting that consist of initialization of $P_1=4.5$ mW, writing of $P_w=7.0$ mW, initialization of $P_{rs}=4.0$ mW, and erasing of $P_e=5.0$ mW.

め,この値を最適記録パワーとする.この結果,オーバー ライト信号として 15 dB を実現した.

以上の結果を要約すると、Fig. 11 の手順でオーバーラ イトが可能になる.まず, as-depo状態 (a) に $P_1=4.5$ mW で5秒間照射すると、マスク層が「AgO_x→ Ag+O₂」 へと変化し、マスク層には銀微粒子が凝集・分散され (b)、マスク層が初期化される.次に、 $P_w=7.0$ mW で記 録する (c).このパワーより高ければ、記録層が熱変形を 起こし消去できず、低ければ不十分な記録(アモルファ ス)状態となる.このときは、記録層のほかにマスク層も 記録され、両層の重畳効果が表れるので、消去する前にマ スク層を均一にするため初期化 (super-RENS 再生) (d) を加える.次に、 $P_e=5.0$ mW で5秒間照射して消去し (e)、初期化 (super-RENS 再生) (f) を加えてマスク層 を均一化し、 $P_w=7.0$ mW で再記録 (c) する.

最後に、繰り返しオーバーライトを行い、書き替え回数 を測定した。Fig. 12 は、 P_i =4.5 mW で5秒間照射して初 期化した後, P_w =7.0 mW で記録, P_{rs} =4.0 mW で super-RENS 再生した後, P_e =5.0 mW で 5 秒間照射して消去, P_{rs} =4.0 mW で super-RENS 再生, P_w =7.0 mW で 再記 録の過程を繰り返した場合の CNR である。現状の媒体で は, オーバーライトを繰り返すと可逆範囲が狭まり, 4 回 目以降は CNR が一定になることがわかる。

7. ま と め

本研究では、熱変形を起こさない程度の小さいパワーで 記録し、マスク層と記録層の相状態を考慮しながら初期化 条件と消去条件を探索し、オーバーライト (CNR=15 dB) を実現した。まず、初期化条件では、 P_1 =4.0 mW を複数 回数あるいは連続照射することにより、マスク層が可逆変 化可能な状態になることがわかった。このとき、 P_1 =2.5 mW の複数照射により「 $Ag+O_2 \rightarrow AgO_x$ 」、 $P_1^u=3.5$ mW の1回照射により「 $AgO_x \rightarrow Ag+O_2$ 」へと変化している ことがわかった。次に、このマスク層の可逆条件を参考 に、記録と消去の前にマスク層を銀微粒子の凝集・分散状 態に初期化する過程を導入することにより、次に示すオー バーライト方法を見いだした。

 による CNR そのものが低下するだけでなく,差分(記録 および消去の相状態の変化の割合)も小さくなるため,現 状の媒体ではオーバーライトは4回までしか認められなか った.なお,この CNR 低下の理由は現在不明である.

今後は、検出限界以下のマーク長で異周波数信号のオー バーライト特性を解析するとともに、繰り返し回数を増加 する条件を考察する予定である。最後に super-RENS デ ィスクを提供していただいた (独)産業技術総合研究所 富 永淳二博士,島隆之博士に感謝します。

文 献

+

- J. Tominaga, T. Nakano and N. Atoda: "An approach for recording and readout beyond the diffraction limit with an Sb thin film," Appl. Phys. Lett., 73 (1998) 2078-2080.
- 2) 田頭 剛, 浮田宏生:開口型 Super-RENS の相変化メカニ ズム,光学,31 (2002) 693-698.
- H. Fuji, J. Tominaga, L. Men, T. Nakano, H. Katayama and N. Atoda: "A near-field recording and readout technology using metallic probe in an optical disk," Jpn. J. Appl. Phys., 39 (2000) 980-981.
- 4) F. H. Ho, H. H. Chang, Y. H. Lin, B. M. Chen, S. Y. Wang and D. P. Tsai: "Functional structures of AgO_x thin film for near-field recording," Jpn. J. Appl. Phys., 42 (2003) 1–5.
- 5) T. Kikukawa, A. Tachibana, H. Fuji and J. Tominaga: "Recording and readout mechanisms of super-resolution near-field structure disc with silver-oxide layer," Jpn. J. Appl. Phys., 42 (2003) 1038-1039.
- 6) H. Ukita, Y. Ueda and M. Sasaki: "Read/write mechanism for a scattered type super-resolution near-field structure using an AgO_x mask layer and the smallest mark reproduced," Jpn. J. Appl. Phys., 44 (2005) 197-201.
- 7) 菅谷寿鴻:"書き替えできる DVD", 応用物理, 67 (1998) 3-12.

220 (46)

+